# (12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

### (19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international





(43) Date de la publication internationale 28 novembre 2002 (28.11.2002)

**PCT** 

(10) Numéro de publication internationale WO 02/095387 A1

- (51) Classification internationale des brevets<sup>7</sup>:
  G01N 27/403, 27/44, 33/18
- (21) Numéro de la demande internationale :

PCT/CH02/00269

- (22) Date de dépôt international: 16 mai 2002 (16.05.2002)
- (25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

- (30) Données relatives à la priorité : 950/01 22 mai 2001 (22.05.2001) CH
- (71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US):

  CSEM CENTRE SUISSE D'ELECTRONIQUE ET

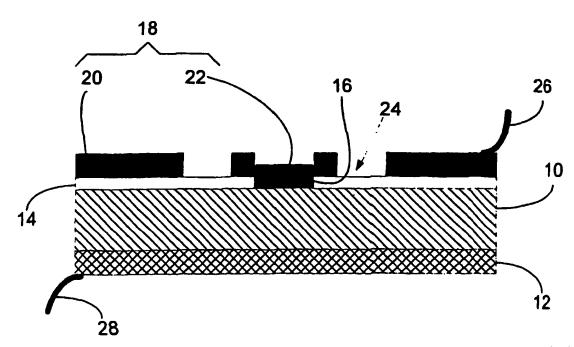
  DE MICROTECHNIQUE SA [CH/CH]; Jaquet-Droz 1,

  CH-2007 Neuchâtel (CH).

- (72) Inventeurs; et
- (75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement): GOBET, Jean [CH/CH]; Cudeau-du-Haut, 22, CH-2035 Corcelles (CH). RYCHEN, Philippe [CH/FR]; 4, rue de l'Eglise, F-68640 Muespach-le-Haut (FR).
- (74) Mandataire: GRESSET-LAESSER; Cabinet de Conseils en Propriété Industrielle, Puits-Godet 8A, CH-2000 Neuchâtel (CH).
- (81) États désignés (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[Suite sur la page suivante]

- (54) Title: ELECTRODE SYSTEM FOR ELECTROCHEMICAL SENSOR
- (54) Titre: SYSTEME D'ELECTRODES POUR CAPTEUR ELECTROCHIMIQUE



(57) Abstract: The system concerns an electrode system for an electrochemical sensor, comprising, arranged on a conductive substrate (10), a plurality of micro-discs (22) electrically connected to the substrate and a generating electrode (20) insulated from the substrate by an insulating layer (14) and including a plurality of orifices (24) concentric with said micro-discs. A conductive layer (12) and connections (26, 28) enable to connect the electrodes to power sources. The generating electrode enables to modify locally, at the micro-discs, the concentrations of species present in solution opposite said electrodes.

WO 02/095387 A1

## WO 02/095387 A1

TO THE CONTROL BY A CONTROL TO THE CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONT

(84) États désignés (régional): brevet ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

avec revendications modifiées

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

#### Publiée:

- avec rapport de recherche internationale

(57) Abrégé: L'invention se rapporte à un système d'électrodes pour capteur électrochimique. Le système d'électrodes comprend, disposées sur un substrat conducteur (10), une pluralité de micro-disques (22) électriquement connectés au substrat et une électrode génératrice (20) isolée du substrat par une couche isolante (14) et présentant une pluralité d'ouvertures (24) concentriques avec lesdits micro-disques. Une couche conductrique (12) et des connexions (26, 28) permettent la connexion des électrodes à des sources d'énergie. L'électrode génératrice permet de modifier localement, au niveau de micro-disques, les concentrations d'espèces présentes en solution en regard desdites électrodes.

15

20

25

30

## SYSTEME D'ELECTRODES POUR CAPTEUR ELECTROCHIMIQUE

La présente invention se rapporte aux capteurs électrochimiques destinés à mesurer la concentration d'une substance chimique dans un liquide. De tels dispositifs trouvent une application particulièrement intéressante, mais non exclusive, à la détection des niveaux de chlore dans l'eau potable ou l'eau des piscines.

Les capteurs électrochimiques de ce type comportent nécessairement une électrode de mesure, une électrode de référence et une contre-électrode. On connaît également un autre type de tels capteurs qui comportent, en outre, une électrode dite génératrice et sa contre-électrode. L'ajout de ces deux dernières électrodes, dont l'effet est de créer des modifications de concentration d'espèces présentes en solution, permet de contrôler localement l'environnement de l'électrode de mesure. Par exemple, le pH de la solution peut être modifié localement par l'application d'un courant à l'électrode génératrice. Un courant cathodique entraînera la production de ions OH- (le pH devenant alors plus basique) et, inversement, un courant anodique entraînera la production de ions H+ (le pH devenant alors plus acide). Une contre-électrode associée à l'électrode génératrice, une contreélectrode associée à l'électrode de mesure (ou de travail) et une électrode de référence sont nécessaires à la réalisation d'un capteur complet. Ces dernières électrodes, dont les dimensions n'ont pas besoin d'être microscopiques, sont bien connues dans le domaine considéré et peuvent être montées séparément. Le document US 5 597 463 décrit, par exemple, un capteur de ce second type, destiné à effectuer un titrage et avec lequel la mesure effectuée est de type potentiostatique.

On comprendra aisément qu'il est particulièrement avantageux d'utiliser, comme électrode de mesure, des électrodes de très petites dimensions, non seulement parce que cela permet de réduire l'espace entre l'électrode de mesure et l'électrode génératrice, mais aussi parce que les effets de la turbulence du liquide dans la cellule s'en trouvent minimisés.

Le document GB 2 290 617 propose une structure à micro-électrodes dans laquelle l'électrode de mesure et l'électrode génératrice se présentent sous la forme de deux peignes dont les doigts sont interdigités. Pour l'un des peignes au moins, les doigts ont une largeur qui est inférieure à 25 μm alors que leur longueur est 20 fois, ou plus, supérieure à la largeur. Typiquement, ces doigts ont une longueur de quelques millimètres et une largeur de 20 μm, l'espace entre deux doigts adjacents des deux peignes pouvant être de 20 μm.

5

10

15

20

25

30

La présente invention a pour but de fournir un système d'électrodes dans lequel l'électrode de mesure et l'électrode génératrice possèdent aussi des micro-structures mais dont, par rapport aux réalisations existantes, l'efficacité est améliorée et le coût de production réduit.

De façon plus précise, afin d'atteindre ce but, l'invention concerne un système d'électrodes pour une cellule électrochimique, du type comportant un substrat et, disposées sur lui et proches l'une de l'autre, une électrode de mesure et une électrode génératrice. Ce système est caractérisé en ce que:

- l'électrode de mesure est formée d'une pluralité de micro-disques électriquement conducteurs régulièrement répartis sur le substrat et réunis électriquement entre eux; et
- l'électrode génératrice est formée d'une plaque électriquement conductrice percée d'ouvertures circulaires de diamètre supérieur à celui des micro-disques et disposée de manière à ce que chaque ouverture soit concentrique à un micro-disque.

De manière avantageuse, les micro-disques ont un diamètre d'environ 5 à 20  $\mu$ m et sont espacés les uns des autres d'environ 100 à 400  $\mu$ m, alors que les ouvertures ont un diamètre supérieur d'environ 10 à 100  $\mu$ m au diamètre des micro-disques.

Selon un premier mode de réalisation préféré:

- le substrat est électriquement conducteur;
- une couche électriquement isolante est déposée sur le substrat et percée d'une pluralité d'ouvertures circulaires;

10

15

20

25

- les micro-disques formant l'électrode de mesure sont constitués par une couche conductrice déposée dans ces ouvertures au contact du substrat; et
- l'électrode génératrice est constituée par une couche conductrice déposée sur la couche isolante.

Dans cette première réalisation, le substrat est, avantageusement, en silicium rendu conducteur par dopage et une couche électriquement conductrice est déposée sous lui.

Selon un deuxième mode de réalisation préféré:

- l'électrode de mesure est constituée par une couche conductrice déposée sur le substrat;
- une couche électriquement isolante est déposée sur la couche conductrice et percée d'une pluralité d'ouvertures circulaires délimitant les micro-disques de l'électrode de mesure; et
- l'électrode génératrice est constituée par une couche conductrice déposée sur la couche isolante.

Dans cette deuxième réalisation, le substrat peut être indifféremment soit en verre ou en quartz, soit en silicium recouvert d'une couche isolante, soit en silicium rendu conducteur par dopage avec, alors, une couche électriquement conductrice déposée sous lui.

Un autre but de la présente invention est de fournir une méthode de détermination du pH d'une eau chlorée à l'aide du capteur ayant les caractéristiques précitées.

D'autres caractéristiques de l'invention ressortiront de la description qui va suivre, faite en regard du dessin annexé, sur lequel:

- la figure 1 est une vue en plan d'un système à micro-électrodes selon l'invention;
- la figure 2 est une vue partielle en coupe à grande échelle d'une première forme de réalisation du système de la figure 1;

10

25

- la figure 3 est un schéma montrant l'effet procuré par une telle structure d'électrodes;
- la figure 4 est une vue partielle en coupe à grande échelle d'une deuxième forme de réalisation du système de la figure 1 ; et
- la figure 5 montre la variation des espèces chlorées dans l'eau en fonction de la valeur de son pH.

On se référera, tout d'abord, aux figures 1 et 2, sur lesquelles on a montré en 10 un substrat électriquement conducteur qui se présente sous la forme d'une plaque carrée de, typiquement, 2 à 10 mm de côté et 0.5 mm d'épaisseur. Cette plaque est, avantageusement, réalisée en silicium rendu conducteur par dopage selon des techniques bien connues de l'homme de métier.

La face inférieure du substrat 10 est recouverte d'une couche conductrice 12 réalisée, par exemple, en titane ou en aluminium ou formée d'un empilement de trois sous-couches de titane, platine et or. L'épaisseur de cette couche, déposée selon tout procédé de métallisation connu, est d'environ 0.2 à 0.3 µm.

En variante, le substrat 10 peut être une simple plaque métallique. Dans ce cas, la couche conductrice 12 est supprimée.

La face supérieure du substrat 10 est recouverte d'une couche isolante 14 formée, par exemple, d'un empilement de deux sous-couches de Si0<sub>2</sub> et Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> connu pour présenter une excellente stabilité en milieu aqueux. L'épaisseur de cette couche est d'environ 0.1 à 0.2 μm.

La couche isolante 14 est percée, par exemple par gravage dans un plasma fluoré, d'un réseau régulier d'ouvertures traversantes circulaires 16 ayant, typiquement, un diamètre d'environ 2 à 20  $\mu$ m et espacées les unes des autres d'environ 100 à 400  $\mu$ m. Dans l'exemple représenté à la figure 1, l'espacement est de 300  $\mu$ m.

La face supérieure de la couche isolante 14, ainsi que les ouvertures 16 pratiquées dans celle-ci, sont recouvertes d'une couche conductrice 18

15

20

25

30

portant la référence 20 lorsqu'elle est sur la couche 14 et la référence 22 lorsqu'elle forme un micro-disque reposant dans l'une des ouvertures circulaires 16. Cette couche 18 est formée, par exemple, d'un empilement d'une couche d'adhérence, d'une couche barrière de diffusion et d'une couche du matériau d'électrode souhaité. Cet empilement, par exemple de titane, de platine et d'or est déposé en une seule fois, selon tout procédé de métallisation connu, et a une épaisseur unique d'environ 0.2 à 0.3 μm.

La couche 18 déposée sur la couche isolante 14 est percée, par gravage chimique, par gravage plasma ou selon le procédé dit de « lift-off », d'un réseau d'ouvertures annulaires 24 entourant chacune l'un des micro-disques 22 et ayant un diamètre extérieur d'environ 30 à 120 μm. L'espace annulaire ainsi dégagé autour des micro-disques a une largeur typique de 5 à 50 μm. On notera que le gravage de la couche 18 est fait de telle sorte que les micro-disques 22 aient un diamètre légèrement supérieur à celui des ouvertures 16 et cela, dans le but d'éviter tout contact de la solution à mesurer avec le substrat 10.

Ainsi est réalisée une microstructure pour capteur électrochimique, dans laquelle:

- la couche conductrice 20 constitue l'électrode génératrice qui peut être connectée directement à une source d'énergie par une liaison 26, et
- l'ensemble des micro-disques conducteurs 22 constituent l'électrode de mesure qui peut être connectée à la souce d'énergie au travers du substrat 10 et de la couche 12, tous deux conducteurs, par une liaison 28 reliée à cette dernière.

Comme déjà mentionné, l'électrode génératrice 20 a pour effet de créer, à son voisinage, des ions H<sup>+</sup> ou OH<sup>-</sup> selon les polarisations appliquées. La figure 3 montre, de manière schématique, que cette électrode établit, dans le liquide 30 où la structure selon l'invention est plongée, une zone de diffusion 32 ayant, typiquement, une épaisseur de 50 à 500 µm selon les conditions

hydrodynamiques, et dans laquelle les ions créés présentent un gradient de concentration. L'environnement de l'électrode de mesure 22 pourra ainsi être modifié (augmentation ou diminution du pH) de manière à être optimal pour l'analyse de l'espèce détectée. Ces ions réagissent alors avec les substances recherchées dans le liquide et les modifications résultantes de la concentration ionique sont détectées grâce à l'ensemble des micro-disques 22 formant l'électrode de mesure.

10

20

25

30

Les avantages de la structure qui vient d'être décrite par rapport à celle du document GB 2 290 617 (déjà mentionné) sont de deux types. Tout d'abord, les micro-disques, ayant deux dimensions (longueur et largeur) faibles par rapport à l'épaisseur de la couche de diffusion, sont des micro-électrodes au sens strict du terme. A l'inverse, les micro-lignes décrites dans le document précité ne possèdent qu'une seule dimension micrométrique; elles ne peuvent, donc, être considérées comme des micro-électrodes que vis-à-vis d'une seule direction du flux de la solution. La structure de l'invention présente, entre autres, les avantages suivants. En premier lieu, elle offre une meilleure indépendance vis-à-vis de la turbulence et de la direction du liquide dans la cellule de mesure et, en second lieu, elle présente une plus faible sensibilité à la conductivité du liquide et offre un meilleur rapport signal/bruit. Enfin, elle assure un espacement unique et parfaitement symétrique entre l'électrode de mesure et l'électrode génératrice. L'action de l'électrode génératrice est fortement améliorée du fait qu'elle a une surface plus importante que celle des micro-disques, qui constituent l'électrode de mesure, et qu'elle est située très près de ces derniers. De plus, la structure proposée est compatible avec les techniques de fabrication par lots et permet, selon l'une de ses variantes, la connexion électrique par la face arrière de l'électrode de mesure.

On se référera maintenant à la figure 4 qui représente une variante de réalisation de la structure précédemment décrite. Dans ce cas, le substrat conducteur 10 de la figure 2 est remplacé par un substrat isolant 34, par exemple, en verre ou en quartz.

15

20

25

La face supérieure du substrat 34 est recouverte d'une couche conductrice 36 qui, comme la couche 18, est réalisée, par exemple, en titane ou formée d'un empilement de trois sous-couches de titane, platine et or. Elle est déposée selon tout procédé de métallisation connu et a une épaisseur d'environ 0.2 à 0.3 µm.

La face supérieure de la couche conductrice 36 est recouverte d'une couche isolante 38 qui, comme la couche 14, est formée, par exemple, d'une couche de nitrure de silicium non stoechiométrique (SiNx) qui peut être déposée à l'aide d'un procédé à basse température (PECVD). L'épaisseur de cette couche est typiquement d'environ 0.1 à 0.2 μm. En vue d'obtenir une meilleure stabilité en milieu aqueux, un polymère organique photosensible, de type époxy ou polyimide, d'une épaisseur typique de 1 à 2μm peut également être utilisé en lieu et place du nitrure de silicium.

La couche isolante 38 est percée, par gravage chimique, d'un réseau régulier d'ouvertures traversantes circulaires 40 ayant, typiquement, comme les ouvertures 16, un diamètre d'environ 2 à 20 μm et espacés d'environ 300 μm.

La face supérieure de la couche isolante 38 est recouverte d'une couche conductrice 42 de même composition et de même épaisseur que la couche 36. Cette couche 42 est percée, par gravage chimique, d'un réseau d'ouvertures circulaires 44 entourant chacune l'une des ouvertures 40 de la couche 38. L'espace annulaire ainsi dégagé autour des ouvertures 40 est, typiquement, de 5 à 50 μm.

Ainsi est réalisée, selon cette variante, une microstructure pour capteur électrochimique, dans laquelle:

- la couche conductrice 42 constitue l'électrode génératrice qui peut être connectée directement à une source d'énergie par une liaison non représentée, et
- la couche conductrice 36 constitue l'électrode de mesure, active seulement par ses portions 46 découvertes par les ouvertures 40,

15

20

25

30

qui peut être connectée directement à la source d'énergie par une liaison non représentée.

La variante de réalisation de la figure 4 peut, elle-même, donner lieu à une première variante dans laquelle le substrat 34 est formé d'une plaque de silicium non spécialement dopé recouverte d'une couche isolante et à une deuxième variante dans laquelle le substrat est formé, comme dans la figure 2, d'une plaque de silicium fortement dopé dont la face arrière est recouverte d'une couche conductrice permettant la connexion.

On se référera maintenant à la figure 5 pour décrire une application avantageuse d'un capteur pourvu d'une électrode génératrice selon la présente invention. Comme déjà mentionné, le chlore est largement utilisé pour la désinfection de l'eau des piscines ou des circuits de distribution en eau potable. Or, le chlore ajouté dans l'eau se trouve sous la forme d'acide hypochloreux (HOCI) ou sous la forme d'hypochlorite (OCI), leurs concentrations respectives dépendant de la valeur du pH, comme l'indiquent les courbes de la figure 5.

On peut voir, sur cette figure 5, que la variation de la concentration d'acide hypochloreux est maximale lorsque le pH varie entre 6,5 et 8,5, alors que cette même variation est très faible lorsque le pH est, soit inférieur à 6, soit supérieur à 9. Ainsi, dans le cadre d'une application du capteur précédemment décrit dans de l'eau potable ou de l'eau de piscine comprenant du chlore, il est possible de mesurer la valeur du pH de cette eau en procédant de la façon suivante.

L'électrode génératrice étant inactive, on mesure d'abord la concentration A d'acide hypochloreux. Ensuite, on active l'électrode génératrice de manière à modifier, localement au niveau des micro-disques, la solution en la rendant plus acide (pH < 5,5) et on mesure la concentration B d'acide hypochloreux. Le pH de la solution est alors déterminé par la valeur du rapport A/B. Afin que cette détermination soit aussi exacte que possible, il conviendra, toutefois, de prendre les précautions suivantes. Le matériau constituant l'électrode de

mesure devra être très sensible à l'acide hypochloreux et très peu sensible à l'hypochlorite. Un matériau, tel le carbone, peut, à cet égard, être considéré comme satisfaisant. L'utilisation d'une membrane anionique, par exemple en un matériau commercialisé sous le nom de Nafion, qui ne laisse pas passer les anions (tels les anions OCl') permet de garantir que seul l'acide hypochloreux sera pris en compte. Enfin, le pH d'une solution variant avec sa température, on s'assurera que celle-ci est la même que celle pour laquelle le capteur utilisé a été calibré.

10

15

20

25

#### REVENDICATIONS

- 1. Système d'électrodes pour une cellule électrochimique, comportant un substrat (10, 34) et, disposées sur lui et proches l'une de l'autre, une électrode de mesure et une électrode génératrice, caractérisé en ce que:
  - l'électrode de mesure est formée d'une pluralité de micro-disques électriquement conducteurs (22, 46) régulièrement répartis sur le substrat et réunis électriquement entre eux; et
  - l'électrode génératrice est formée d'une plaque électriquement conductrice (20, 42) percée d'ouvertures circulaires (24, 44) de diamètre supérieur à celui des micro-disques et disposée de manière à ce que chaque ouverture soit concentrique à un microdisque.
- 2. Système selon la revendication 1, caractérisé en ce que les micro-disques (22, 46) ont un diamètre d'environ 2 à 20  $\mu$ m et sont espacés les uns des autres d'environ 100 à 400  $\mu$ m, et en ce que les ouvertures (24, 44) ont un diamètre d'environ 30 à 120  $\mu$ m.
- 3. Système selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que:
  - le substrat (10) est électriquement conducteur,
  - il comporte une couche électriquement isolante (14) déposée sur le substrat et percée d'une pluralité d'ouvertures circulaires (16),
  - les micro-disques formant l'électrode de mesure sont constitués par une couche conductrice (22) déposée dans lesdites ouvertures au contact du substrat, et
  - l'électrode génératrice est constituée par une couche conductrice (20) déposée sur la couche isolante (14).
- Système selon la revendication 3, caractérisé en ce que le substrat (10) est en silicium rendu conducteur par dopage.
- 5. Système selon la revendication 4, caractérisé en ce qu'il comporte une couche électriquement conductrice (12) déposée sous le substrat (10).
- 30 6. Système selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que:

10

- l'électrode de mesure est constituée par une couche conductrice (36) déposée sur le substrat (34),
- il comporte une couche électriquement isolante (38) déposée sur la couche conductrice (36) et percée d'une pluralité d'ouvertures circulaires (40) délimitant les micro-disques (46) de l'électrode de mesure, et
- l'électrode génératrice est constituée par une couche conductrice (42) déposée sur la couche isolante (38).
- 7. Système selon la revendication 6, caractérisé en ce que le substrat (34) est en verre ou en quartz.
  - 8. Système selon la revendication 6, caractérisé en ce que le substrat (34) est formé d'une plaque de silicium recouverte d'une couche isolante.
  - 9. Système selon la revendication 6, caractérisé en ce que le substrat (34) est en silicium rendu conducteur par dopage.
- 10. Système selon la revendication 9, caractérisé en ce qu'il comporte une couche électriquement conductrice déposée sous le substrat (34).
  - 11. Méthode de détermination de la valeur de pH d'une eau chlorée à l'aide d'un capteur électrochimique pourvu d'un système d'électrodes selon l'une des revendications 1 à 10, caractérisée en ce qu'elle consiste à :
- mesurer une première concentration A d'acide hypochloreux lorsque l'électrode génératrice est inactive ;
  - activer ladite électrode génératrice de façon à amener le pH de l'eau au niveau des micro-disques de l'électrode de mesure à un niveau d'acidité suffisant;
- mesurer une seconde concentration B d'acide hypochloreux en milieu acide ; et
  - déterminer la valeur de pH à partir du rapport de ladite première concentration à ladite seconde concentration.

10

15

25

30

PCT/CH02/00269 12

#### **REVENDICATIONS MODIFIEES**

[reçues par le Bureau international le 08 Octobre 2002(08.10.02) revendications 1-10 remplaçées par les revendications 1-19 modifiées (2pages)]

- 1. Système d'électrodes pour une cellule électrochimique, caractérisé en ce qu'il comporte :
  - un substrat (10) électriquement conducteur,
  - une couche électriquement isolante (14) déposée sur le substrat et percée d'une pluralité d'ouvertures circulaires (16),
  - une couche électriquement conductrice (22) déposée dans lesdites ouvertures au contact du substrat et sur une portion de la couche isolante (10) qui les entoure, constituant une pluralité de microdisques qui forment une électrode de mesure et,
  - une couche électriquement conductrice (20) déposée sur la couche isolante (14), percée d'ouvertures circulaires (24) de diamètre supérieur à celui des micro-disques et disposée de manière à ce que chaque ouverture soit concentrique à un micro-disque, ladite couche constituant une électrode génératrice.
- 2. Système selon la revendication 1, caractérisé en ce que le substrat (10) est en silicium rendu conducteur par dopage.
- 3. Système selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'il comporte une couche électriquement conductrice (12) déposée sous le substrat (10).
- 4. Système d'électrodes pour une cellule électrochimique, caractérisé en ce 20 qu'il comporte :
  - un substrat (34) électriquement isolant,
  - une couche électriquement conductrice (36) déposée sur le substrat (34) et formant une électrode de mesure,
  - une couche électriquement isolante (38) déposée sur la couche conductrice (36) et percée d'une pluralité d'ouvertures circulaires (40) délimitant des micro-disques (46) sur l'électrode de mesure, et
  - une couche électriquement conductrice (42) déposée sur la couche isolante (38), percée d'ouvertures circulaires (44) de diamètre supérieur à celui des micro-disques et disposée de manière à ce

que chaque ouverture soit concentrique à un micro-disque, ladite couche constituant une électrode génératrice.

- 5. Système selon la revendication 4, caractérisé en ce que le substrat (34) est en verre ou en quartz.
- 6. Système selon la revendication 4, caractérisé en ce que le substrat (34) est formé d'une plaque de silicium recouverte d'une couche isolante.
  - 7. Système selon la revendication 4, caractérisé en ce que le substrat (34) est en silicium rendu conducteur par dopage.
- 8. Système selon la revendication 7, caractérisé en ce qu'il comporte une couche électriquement conductrice déposée sous le substrat (34).
  - 9. Système selon l'une des revendications 1 et 4, caractérisé en ce que les micro-disques (22, 46) ont un diamètre d'environ 2 à 20 μm et sont espacés les uns des autres d'environ 100 à 400 μm, et en ce que les ouvertures (24, 44) ont un diamètre d'environ 30 à 120 μm.
- 10. Méthode de détermination de la valeur de pH d'une eau chlorée à l'aide d'un capteur électrochimique pourvu d'un système d'électrodes selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisée en ce qu'elle consiste à :
  - mesurer une première concentration A d'acide hypochloreux lorsque l'électrode génératrice est inactive ;
- activer ladite électrode génératrice de façon à amener le pH de l'eau au niveau des micro-disques de l'électrode de mesure à un niveau d'acidité suffisant;
  - mesurer une seconde concentration B d'acide hypochloreux en milieu acide ; et
- déterminer la valeur de pH à partir du rapport de ladite première concentration à ladite seconde concentration.

WO 02/095387 PCT/CH02/00269

1/3

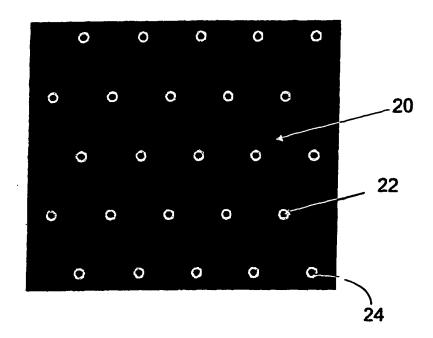


Fig. 1

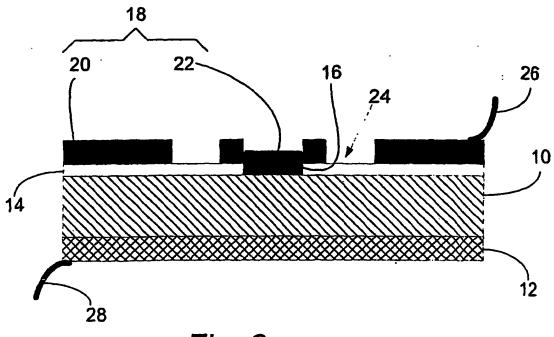


Fig. 2

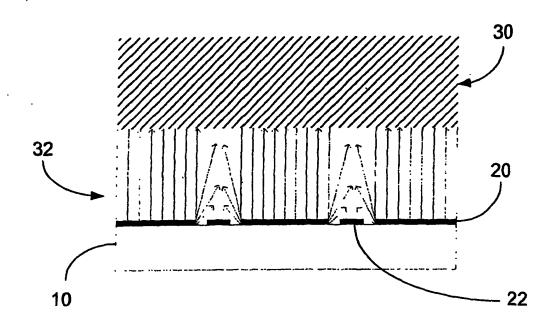


Fig. 3

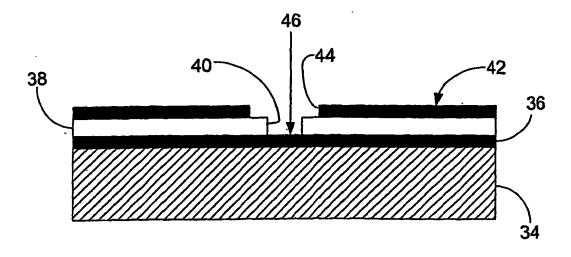


Fig. 4

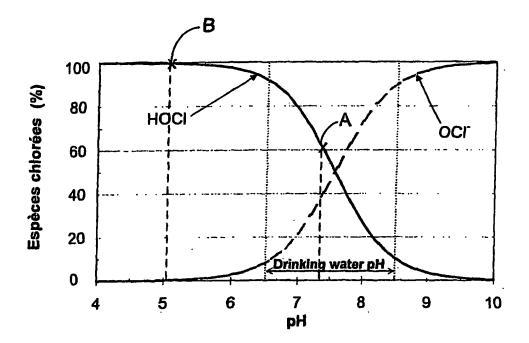


Fig. 5

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 G01N27/403 G01N27/44 G01N33/18

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

#### **B. FIELDS SEARCHED**

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 GO1N

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included. In the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, COMPENDEX, INSPEC

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	relevant passages	Relevant to claim No.
	Common of a second control of the second con		
X	ROSS B: "ULTRAMICROELECTRODE A TRANSDUCERS FOR NEW AMPEROMETRI SENSORS" SENSORS AND ACTUATORS B, ELSEVI S.A., LAUSANNE, CH, vol. B07, no. 1 / 3, 1 March 1992 (1992-03-01), page XP000287020 ISSN: 0925-4005 page 758, right-hand column, pa -page 759, left-hand column, pa figures 2,4	C OXYGEN  ER SEQUOIA  s 758-762,  ragraph 1	1-10
X	DE 41 31 731 A (RAYMOND GLOCKER FUER) 19 May 1993 (1993-05-19) column 1, line 3-5 column 1, line 29,30 column 1, line 50-68; figures 1		1–10
X Furt	ther documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family members are listed	in annex.
"A" docume consider "E" earlier of filing of "L" docume which citatio "O" docume other "P" docume later ti	ent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance document but published on or after the international date ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another n or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means ent published prior to the international filling date but than the priority date claimed	"T" later document published after the inte or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention state of particular relevance; the cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the document of particular relevance; the cannot be considered to involve an in document is combined with one or ments, such combination being obvio in the art.  "&" document member of the same patent Date of mailing of the International second	eory underlying the claimed invention to econsidered to comment is taken alone claimed invention ventive step when the ore other such docuus to a person skilled
2	August 2002	12/08/2002	
Name and r	mailing address of the ISA	Authorized officer	

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

Meyer, F

Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Chauson of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to daim No.
WO 97 38301 A (EL KHAKANI MY ALI ;INST NAT RECH SCIENT IN (CA); CHAKER MOHAMED (C) 16 October 1997 (1997-10-16) page 5, line 3 -page 9, line 28; figures 3,4,5D	1-10
US 5 512 489 A (SEDDON BRIAN J ET AL) 30 April 1996 (1996-04-30) column 1, line 45-64 column 5, line 13-32; figures 1,2	1-10
US 6 020 110 A (ARNOLD PETER THOMAS ET AL) 1 February 2000 (2000-02-01) column 1, line 46 -column 2, line 27 column 4, line 9-24; figures 1,2	1-10
FR 2 675 260 A (AIX MARSEILLE UNIVERS DROIT EC) 16 October 1992 (1992-10-16) page 10, line 23 -page 12, line 23; figures 1,7	11
GB 2 290 617 A (SIEMENS PLESSEY CONTROLS LTD) 3 January 1996 (1996-01-03) cited in the application the whole document	1,11
US 5 597 463 A (BIRCH BRIAN J ET AL) 28 January 1997 (1997-01-28) cited in the application the whole document	1,11
	WO 97 38301 A (EL KHAKANI MY ALI ;INST NAT RECH SCIENT IN (CA); CHAKER MOHAMED (C) 16 October 1997 (1997-10-16) page 5, line 3 -page 9, line 28; figures 3,4,5D  US 5 512 489 A (SEDDON BRIAN J ET AL) 30 April 1996 (1996-04-30) column 1, line 45-64 column 5, line 13-32; figures 1,2  US 6 020 110 A (ARNOLD PETER THOMAS ET AL) 1 February 2000 (2000-02-01) column 1, line 46 -column 2, line 27 column 4, line 9-24; figures 1,2  FR 2 675 260 A (AIX MARSEILLE UNIVERS DROIT EC) 16 October 1992 (1992-10-16) page 10, line 23 -page 12, line 23; figures 1,7  GB 2 290 617 A (SIEMENS PLESSEY CONTROLS LTD) 3 January 1996 (1996-01-03) cited in the application the whole document  US 5 597 463 A (BIRCH BRIAN J ET AL) 28 January 1997 (1997-01-28) cited in the application

ı	PCT/	CH	02/	00	26	9
---	------	----	-----	----	----	---

			_	1 '	.,	02, 00200
Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
DE 4131731	Α	19-05-1993	DE	4131731	A1	19-05-1993
WO 9738301	А	16-10-1997	CA	2173932	A1	12-10-1997
		•	AU	2283797	Α	29-10-1997
			WO	9738301		16-10-1997
			JP	2000517413	T	26-12-2000
US 5512489	А	30-04-1996	AT	126888	T	15-09-1995
			AU	6880091		26-06-1991
		•	DE	69021888		28-09-1995
			DE	69021888		11-04-1996
			DK	504196		22-01-1996
			EP	0504196		23-09-1992
			EP	0653629		17-05-1995
			ES	2077213		16-11-1995
			WO	9108474		13-06-1991
			US	5635054		03-06-1997
~			US 	5739039	A 	14-04-1998
US 6020110	Α	01-02-2000	CA	2193350		04-01-1996
			EΡ	0766820		09-04-1997
			WO	9600385		04-01-1996
			JP	10502731	T 	10-03-1998
FR 2675260	Α	16-10-1992	FR	2675260	A1	16-10-1992
GB 2290617	Α	03-01-1996	NONE			
US 5597463	Α	28-01-1997	AU	2743595	- <b></b>	25-01-1996
			WO	9601422		18-01-1996
			TR	960028		21-06-1996

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE CIB 7 G01N27/403 G01N27/44 G01N33/18

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

## B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) CIB 7 GO1N

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés) EPO-Internal, COMPENDEX, INSPEC

Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'Indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	ROSS B: "ULTRAMICROELECTRODE ARRAYS AS TRANSDUCERS FOR NEW AMPEROMETRIC OXYGEN SENSORS"  SENSORS AND ACTUATORS B, ELSEVIER SEQUOIA S.A., LAUSANNE, CH, vol. B07, no. 1 / 3, 1 mars 1992 (1992-03-01), pages 758-762, XP000287020  ISSN: 0925-4005  page 758, colonne de droite, alinéa 1 -page 759, colonne de gauche, alinéa 2; figures 2,4	1-10
X	DE 41 31 731 A (RAYMOND GLOCKER GMBH INST FUER) 19 mai 1993 (1993-05-19) colonne 1, ligne 3-5 colonne 1, ligne 29,30 colonne 1, ligne 50-68; figures 1,2	1-10

Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe
Catégories spéciales de documents cités:  'A' document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent  'E' document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date  'L' document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)  'O' document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens	T* document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention  X* document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément  Y* document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente
'P' document publié avant la date de dépôt international, mais	pour une personne du métier &' document qui fait partie de la même famille de brevets
Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée	Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale
2 août 2002	12/08/2002
Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Fonctionnaire autorisé  Meyer, F
Formulaire PCT/ISA/210 (deuxième feuille) (juillet 1992)	

## | PCI/CH U2/00269

identification des documents cités, avec,le cas échéant, l'indicationdes passages pertinents	no. des revendications visées
WO 97 38301 A (EL KHAKANI MY ALI ;INST NAT RECH SCIENT IN (CA); CHAKER MOHAMED (C) 16 octobre 1997 (1997-10-16) page 5, ligne 3 -page 9, ligne 28; figures 3,4,5D	1-10
US 5 512 489 A (SEDDON BRIAN J ET AL) 30 avril 1996 (1996-04-30) colonne 1, ligne 45-64 colonne 5, ligne 13-32; figures 1,2	1-10
US 6 020 110 A (ARNOLD PETER THOMAS ET AL) 1 février 2000 (2000-02-01) colonne 1, ligne 46 -colonne 2, ligne 27 colonne 4, ligne 9-24; figures 1,2	1-10
FR 2 675 260 A (AIX MARSEILLE UNIVERS DROIT EC) 16 octobre 1992 (1992-10-16) page 10, ligne 23 -page 12, ligne 23; figures 1,7	11
GB 2 290 617 A (SIEMENS PLESSEY CONTROLS LTD) 3 janvier 1996 (1996-01-03) cité dans la demande le document en entier	1,11
US 5 597 463 A (BIRCH BRIAN J ET AL) 28 janvier 1997 (1997-01-28) cité dans la demande le document en entier	1,11
	RECH SCIENT IN (CA); CHAKER MOHAMED (C) 16 octobre 1997 (1997-10-16) page 5, ligne 3 -page 9, ligne 28; figures 3,4,5D  US 5 512 489 A (SEDDON BRIAN J ET AL) 30 avril 1996 (1996-04-30) colonne 1, ligne 45-64 colonne 5, ligne 13-32; figures 1,2  US 6 020 110 A (ARNOLD PETER THOMAS ET AL) 1 février 2000 (2000-02-01) colonne 1, ligne 46 -colonne 2, ligne 27 colonne 4, ligne 9-24; figures 1,2  FR 2 675 260 A (AIX MARSEILLE UNIVERS DROIT EC) 16 octobre 1992 (1992-10-16) page 10, ligne 23 -page 12, ligne 23; figures 1,7  GB 2 290 617 A (SIEMENS PLESSEY CONTROLS LTD) 3 janvier 1996 (1996-01-03) cité dans la demande le document en entier  US 5 597 463 A (BIRCH BRIAN J ET AL) 28 janvier 1997 (1997-01-28) cité dans la demande

PCT/	CH 02/	00269
------	--------	-------

				1	1017 011 027 00203		
Document brevet cité lu rapport de recherche		Date de publication		Membre(s) de la famille de brevet(s		Date de publication	
DE 4131731	Α	19-05-1993	DE	4131731	A1	19-05-1993	
WO 9738301	 А	16-10-1997	CA	2173932		12-10-1997	
			ΑU	2283797	Α	29-10-1997	
			WO	9738301		16-10-1997	
			JP	2000517413	Τ	26-12-2000	
US 5512489	A	30-04-1996	AT	126888	T	15-09-1995	
			ΑU	6880091		26-06-1991	
			DE	69021888		28-09-1995	
			DE	69021888		11-04-1996	
			DK	504196		22-01-1996	
			EP	0504196		23-09-1992	
			ΕP	0653629		17-05-1995	
			ES	2077213		16-11-1995	
			WO	9108474		13-06-1991	
			US	5635054		03-06-1997	
			US	5739039 	Α	14-04-1998	
US 6020110	A	01-02-2000	CA	2193350		04-01-1996	
			EP	0766820		09-04-1997	
			WO	9600385		04-01-1996	
		_	JP	10502731	T	10-03-1998	
FR 2675260	Α	16-10-1992	FR	2675260	A1	16-10-1992	
GB 2290617	Α	03-01-1996	AUC	UN			
US 5597463	Α	28-01 <b>-</b> 1997	AU	2743595	A	25-01-1996	
			WO	9601422	2 A1	18-01-1996	
			TR	960028		21-06-1996	